第四章

Q2: 室温下,半导体 Si 掺 B 的浓度为10¹⁴cm⁻³,同时掺有浓度为1.1×10¹⁵cm⁻³的 P,分别求电子浓度、空穴浓度以及费米能级相对于导带底的位置。将该半导体由室温升至 570K,则多子浓度、少子浓度又分别为多少?费米能级相对于禁带中央的位置如何?

(已知: 室温下, $n_i \approx 1.5 \times 10^{10} \, cm^{-3}$; 570K 时, $n_i \approx 3 \times 10^{15} \, cm^{-3}$)解:

1) B:p型杂质, P: n型杂质。室温下杂质全部电离,杂质补偿作用后,电子浓度为:

$$n_0 = N_D = N_D - N_A = 1.1 \times 10^{15} - 1 \times 10^{14} = 1 \times 10^{15} cm^{-3}$$

室温下 $n_i = 1.5 \times 10^{10} cm^{-3}$,所以空穴浓度: $p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = 2.25 \times 10^5 cm^{-3}$;

2) 当 T=570K 时, $n_i \approx 3 \times 10^{15} cm^{-3}$, $N_{eff} = 1 \times 10^{15} cm^{-3}$,与 n_i 可比拟,为过渡区

$$N_{eff} = 1 \times 10^{15} \, cm^{-3}$$

$$N_{eff} + p_0 = n_0$$

$$n_0 p_0 = n_i^2$$

$$\Rightarrow p_0 = 2.54 \times 10^{15} \, cm^{-3}$$

$$n_0 = 3.54 \times 10^{15} \, cm^{-3}$$

$$\chi n_0 = n_i e^{\frac{E_F - E_i}{k_0 T}}, \quad \text{所以费米能级相对于禁带中央的位置为:}$$

$$E_F - E_i = k_0 T \ln \left(\frac{n_0}{n_i}\right)$$

$$0.026 \times \frac{570}{300} \ln \left(\frac{3.54}{3}\right) \approx 0.008 eV$$

即为弱 n 型半导体,接近于本征半导体。

Q4: 室温下,若两块 Si 样品中的电子浓度分别为2.25×10¹⁰ cm⁻³和 6.8×10¹⁶ cm⁻³,试分别求出其中的空穴浓度和费米能级的相对位置,并 判断样品的导电类型。2)假如再在其中都掺入浓度为2.25×10¹⁶ cm⁻³ 的 受主杂质,这两块样品的导电类型又将怎样? 解:

_{1)由于}
$$n_0 p_0 = n_i^2$$
,室温下 $n_i = 1.5 \times 10^{10}$,

所以有
$$\begin{cases} p_{01} = \frac{n_i^2}{n_{01}} = \frac{\left(1.5 \times 10^{10}\right)^2}{2.25 \times 10^{10}} = 1.0 \times 10^{10} \,\mathrm{cm}^{-3} \\ p_{02} = \frac{n_i^2}{n_{02}} = \frac{\left(1.5 \times 10^{10}\right)^2}{6.8 \times 10^{16}} \approx 3.3 \times 10^3 \,\mathrm{cm}^{-3} \end{cases},$$

$$\downarrow \text{ The power of the properties of the p$$

則有
$$\begin{cases} E_{F1} = E_{v} + k_{0}T \ln \left(\frac{N_{v}}{p_{01}}\right) = E_{v} + 0.026 \times \ln \left(\frac{1.2 \times 10^{19}}{1.0 \times 10^{10}}\right) \approx E_{v} + 0.544 eV \\ E_{F2} = E_{v} + k_{0}T \ln \left(\frac{N_{v}}{p_{02}}\right) = E_{v} + 0.026 \times \ln \left(\frac{1.2 \times 10^{19}}{3.3 \times 10^{3}}\right) \approx E_{v} + 0.932 eV \end{cases}$$

因为 \mathbf{n}_{01} 稍大于 \mathbf{p}_{01} ,所以为弱 \mathbf{n} 型半导体; $\mathbf{n}_{02} > \mathbf{p}_{02}$,所以也为 \mathbf{n} 型半导体。

2) 假如再在其中都掺入浓度为2.25×10¹⁶cm⁻³的受主杂质,那么将 出现杂质补偿,

第一种半导体补偿后将变为 p 型半导体,

$$p_0 = 2.25 \times 10^{16} - 2.25 \times 10^{10} \approx 2.25 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

第二种半导体补偿后还是为 n 型半导体

$$n_0 = 6.8 \times 10^{16} - 2.25 \times 10^{16} \approx 4.55 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

Q5: 掺有受主浓度为 8.0×10^6 cm⁻³ 和施主浓度为 7.25×10^{17} cm⁻³ 的 Si 材料, 试求温度分别为 300K 和 400K 时此材料的载流子浓度和费米 能级的相对位置。

解:由于杂质基本全电离,杂质补偿之后,有效施主浓度为:

$$N_{eff} = N_D - N_A = 7.25 \times 10^{17} - 8 \times 10^6 \approx 7.25 \times 10^{17} cm^{-3}$$

1) T=300K 时:

电子浓度:
$$n_0 = N_{eff} = 7.25 \times 10^{17} cm^{-3}$$

空穴浓度:
$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{\left(1.5 \times 10^{10}\right)^2}{7.25 \times 10^{17}} \approx 3.10 \times 10^2 cm^{-3}$$

费米能级的位置:

$$E_F = E_V + k_0 T \ln\left(\frac{N_V}{p_0}\right) = E_V + 0.026 \times \ln\left(\frac{1.2 \times 10^{19}}{3.10 \times 10^2}\right) = E_V + 0.993 eV$$
;

T=400K 时,查图 4-6, n_i(400K)=4×10¹²cm⁻³,可忽略本征电离

电子浓度:
$$n_0 = N_{eff} = 7.25 \times 10^{17} cm^{-3}$$

空穴浓度:
$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{(4.0 \times 10^{12})^2}{7.25 \times 10^{17}} = 2.21 \times 10^7 cm^{-3}$$

费米能级的位置:

$$n_0 = n_i e^{\frac{E_F - E_i}{k_0 T}}$$

$$\Rightarrow E_F - E_i = k_0 T \ln \frac{n_0}{n_i} = 0.026 \times \frac{400}{300} \times \ln \frac{7.25 \times 10^{17}}{4 \times 10^{12}} = 0.42 eV$$

Q8: 有一 Si 样品,在温度为 300k 时,施主与受主的浓度差 $N_D - N_A = 10^{14} \, cm^{-3}$,设杂质全部电离,已知该温度下导带底的有效状态 密度 $N_C = 2.9 \times 10^{19} \, cm^{-3}$,Si 的本征载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \, cm^{-3}$,试求样品

的费米能级位置。

解:可忽略本征激发,位于强电离区: $n_0 \approx N_D - N_A = 10^{14} cm^{-3}$,

$$n_{0} = N_{C}e^{\left(-\frac{E_{C} - E_{F}}{k_{0}T}\right)},$$

$$\Rightarrow E_{F} = E_{C} + k_{0}T \ln\left(\frac{n_{0}}{N_{C}}\right) = E_{C} + 0.026 \times \ln\left(\frac{10^{14}}{2.8 \times 10^{19}}\right) = E_{C} - 0.326eV$$

即样品的费米能级在位于导带底 E_c 下方0.326eV处。

Q9: 室温下,某非简并 n 型 Si 样品中受主杂质浓度为 $N_A = 10^{16} cm^{-3}$,其费米能级位于导带底之下 0.20 eV 之处。假设杂质全部电离,试求其中施主浓度的数值。

解: T = 300K时,导带底的有效状态密度 $N_c = 2.8 \times 10^{19} cm^{-3}$, 硅的本征载流子浓度为 $n_i = 1.5 \times 10^{10} cm^{-3}$,由样品费米能级位置可知其为 n 型半导体,

所以有 $n_0 > p_0$,同时由题意知: $E_c - E_F = 0.2eV$,

则导带电子浓度为: $\mathbf{n}_0 = N_C \mathbf{e}^{\left(-\frac{E_C - E_F}{k_0 T}\right)} = 2.8 \times 10^{19} \times e^{\left(-\frac{0.2}{0.026}\right)} = 1.26 \times 10^{16} cm^{-3}$ 由于 $\mathbf{n}_0 \approx N_D - N_A$,

所以施主浓度为: $N_D = n_0 + N_A = 1.0 \times 10^{16} + 1.26 \times 10^{16} = 2.26 cm^{-3}$

Q11: n-Si 半导体样品受均匀光照产生非平衡载流子电子-空穴对,其净产生率 $G=10^{16}/(\text{cm}^3\cdot\text{s})$ 。已知注入为小注入水平,非子空穴的寿命为 $\tau_p=10\mu s$,求光照停止 30 μ s 后的过剩空穴浓度。

$$\frac{\partial \left(\Delta p\right)}{\partial t} = -\frac{\Delta p}{\tau_{p}} + G$$

光照时,为稳态, $\frac{\partial \left(\Delta p\right)}{\partial t}$

解:

$$\therefore -\frac{\Delta p}{\tau_{p}} + G=0$$

$$\Rightarrow (\Delta p)_{0} = G\tau_{p} = 10^{16} \times 10 \times 10^{-6} = 10^{11} cm^{-3}$$

光照停止后,G=0

$$\frac{\partial \left(\Delta p\right)}{\partial t} = -\frac{\Delta p}{\tau_{_{\rm D}}}$$

通解为:
$$\Delta p(t) = \Delta p_0 e^{\left(-\frac{t}{\tau_p}\right)}$$

所以:
$$\Delta p(30) = \Delta p_0 e^{\left(-\frac{30}{\tau_p}\right)} = 10^{11} \times e^{-\frac{30}{10}} = 4.98 \times 10^9 \, cm^{-3}$$
。

测试题

Q1: E_F在 E_D的上面,只有部分杂质电离,忽略本征激发

电中性方程:
$$n_{p}^{+} = n_{0}$$

$$\frac{N_{p}}{1 + 2e^{\frac{-E_{p} - E_{F}}{k_{0}T}}} = N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{k_{0}T}\right)$$

$$\Rightarrow N_{p} = \left[1 + 2e^{\frac{-E_{p} - E_{F}}{k_{0}T}}\right] \cdot N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{k_{0}T}\right)$$

$$\therefore E_{F} = \frac{E_{c} + E_{p}}{2} \Rightarrow E_{c} - E_{F} = E_{F} - E_{p}$$

$$\therefore E_{c} - E_{p} = 0.039 \text{ eV} \Rightarrow E_{c} - E_{F} = E_{F} - E_{p} = 0.0195 \text{ eV}$$

$$N_{p} = \left[1 + 2e^{\frac{-E_{p} - E_{F}}{k_{0}T}}\right] \cdot N_{c} \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{F}}{k_{0}T}\right)$$

$$= \left(1 + 2e^{\frac{0.0195}{0.026}}\right) \times 2.8 \times 10^{19} e^{\frac{-0.0195}{0.026}}$$

$$= 6.92 \times 10^{19} cm^{-3}$$

Q2: 证明: 对于基体半导体相同的 p 型非简并半导体和 n 型非简并半导体,如果 $N_A = N_D$,则这两个半导体的费米能级 E_{Fp} 和 E_{Fn} 是关于禁带中央对称的。假设杂质全电离。

证明:

已知
$$\begin{cases} \mathbf{n}_0 = n_i e^{\left(\frac{E_F - E_i}{k_0 T}\right)} \\ p_0 = n_i e^{\left(\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right)} \end{cases}$$
, 因为杂质全部电离,则有
$$\begin{cases} \mathbf{N}_D \approx \mathbf{n}_0 = n_i e^{\left(\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right)} \\ N_A \approx p_0 = n_i e^{\left(\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right)} \end{cases}$$

且由题意有: $N_D = N_A$,

所以有
$$n_i e^{\left(\frac{E_{F_n}-E_i}{k_0T}\right)} = n_i e^{\left(\frac{E_i-E_{F_p}}{k_0T}\right)}$$
,即有: $E_{F_n}-E_i=E_i-E_{F_p}$

即证这两个半导体的费米能级 E_{Fp} 和 E_{Fn} 是关于禁带中央对称的。

Q4: 某掺杂 B 的非简并 p 型 Si 中含有一定浓度的 In,室温下测出空穴浓度为 $p_0 = 1.1 \times 10^{16} cm^{-3}$,已知 B 的浓度为 $N_{AI} = 10^{16} cm^{-3}$,其电离能为 $\Delta E_{AI} = 0.045 eV$, In 的电离能为 $\Delta E_{A2} = 0.16 eV$,求半导体中 In 的浓度。 另已知 $N_V = 1.04 \times 10^{19} cm^{-3}$ 。

解:

由
$$\mathbf{p}_0 = N_V e^{\left(-\frac{E_F - E_V}{k_0 T}\right)},$$
 得 $\mathbf{E}_F = E_V + k_0 T \ln\left(\frac{N_V}{\mathbf{p}_0}\right) = E_V + 0.026 \times \ln\left(\frac{1.04 \times 10^{19}}{1.1 \times 10^{16}}\right) = E_V + 0.178 eV$

由题意知 $E_F - E_{A1} = 0.178 - 0.045 = 0.133eV, E_F - E_{A2} = 0.178 - 0.16 = 0.018eV$,

价带空穴 p_0 是由两种杂质电离后提供的,即:

$$p_0 = \frac{N_{A1}}{1 + 4e^{\left(-\frac{E_F - E_{A1}}{k_0 T}\right)}} + \frac{N_{A2}}{1 + 4e^{\left(-\frac{E_F - E_{A2}}{k_0 T}\right)}}$$

所以
$$N_{A2} = \left[1 + 4e^{\left(\frac{E_{A2} - E_F}{k_0 T}\right)}\right] \cdot \left[p_0 - \frac{N_{A1}}{1 + 4e^{\left(\frac{E_{A1} - E_F}{k_0 T}\right)}}\right]$$

$$= \left[1 + 4e^{\left(-\frac{0.018}{0.026}\right)}\right] \cdot \left[1.1 \times 10^{16} - \frac{10^{16}}{1 + 4e^{\left(-\frac{0.133}{0.026}\right)}}\right]$$

$$= 1.59 \times 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-3}$$

Q5: 试证明在小信号条件下,本征半导体的非平衡载流子的寿命最长。证明: 本征半导体即无杂质的纯净半导体

∴ 复合只能是直接复合

直接复合时,
$$R = rnp$$
, $G = rn_i^2$

$$U = R - G = rnp - rn_i^2$$
净复合率:
$$= r(n_0 + p_0)\Delta p + r(\Delta p)^2$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{\Delta p}{U} = \frac{1}{r(n_0 + p_0) + r\Delta p}$$

在小信号条件下, $(n_0 + p_0) \gg \Delta p$,本征半导体的非平衡载流子的 $\sharp \pitchfork \tau \approx \frac{1}{r(n_0 + p_0)} = \frac{1}{2rn_i} ,$

而
$$n_0 + p_0 \ge 2\sqrt{n_0 p_0} = 2n_i$$
, 所以有 $\tau \le \frac{1}{2rn_i}$

即本征半导体的非平衡载流子的寿命最长。

Q6: 一束恒定光源照在 n 型 Si 单晶样品上,其平衡载流子浓度 $n_0 = 10^{14} cm^{-3}$,且每微秒产生的电子一空穴对浓度为 $10^{13} cm^{-3}$ 。如 $\tau_n = \tau_p = 2\mu s$,试求光照后少数载流子浓度。(已知本征载流子浓度 $n_s = 9.65 \times 10^9 cm^{-3}$)。

- Q7: 施主浓度为 10^{15} cm^{-3} 的均匀半无限长 Si 棒(x=0)的一端受到光辐照产生了过剩空穴。光只照在表面而形成了稳态,过剩空穴浓度分布为: $\Delta p_n(x) = \Delta p_{n0} \exp\left(-x/L_p\right)$,光照表面处的 $\Delta p_{n0} = 1.5 \times 10^{10}$ cm^{-3} 。已知小注入条件成立。
- (1) 对于光照的半导体样品,分别写出载流子浓度分布关系 n(x)和 p(x)。
- (2) 在光照的 Si 半导体样品内,分别建立电子和空穴的准费米能级的关系式。

解:

(1)

$$n(\mathbf{x}) = \mathbf{n}_0 + \Delta n(\mathbf{x}) \approx n_0$$

$$p(\mathbf{x}) = \mathbf{p}_0 + \Delta p(\mathbf{x}) = \mathbf{p}_0 + \Delta p_{n0} e \left(-\frac{x}{L_p} \right)$$

(2)

所以
$$E_F^n \approx E_F = E_C + k_0 T \ln \left(\frac{\mathbf{n}_0}{N_c} \right)$$

曲于
$$p(x)=n_i \exp(\frac{E_i-E_F^p}{k_0T})$$
,所以 $E_F^p=E_i+k_0T\ln(\frac{n_i}{p(x)})$